7/5/1
DIALOG(R) File 347: JAPIO
(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02704314

DIAGNOSIS OF SENSOR ABNORMALITY

PUB. NO.: 64-001914 [JP 64001914 A] PUBLISHED: January 06, 1989 (19890106)

INVENTOR(s): ONO HIDETAKA ONISHI TAKASHI

APPLICANT(s): MITSUBISHI HEAVY IND LTD [000620] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 62-155546 [JP 87155546]

APPL. NO.: 62-155546 [JP 87155546] FILED: June 24, 1987 (19870624)

INTL CLASS: [4] G01D-021/00; G01N-027/00

JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 46.2 (INSTRUMENTATION

-- Testing)

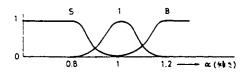
JOURNAL: Section: P, Section No. 860, Vol. 13, No. 165, Pg. 19, April

20, 1989 (19890420)

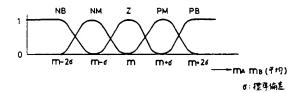
#### ABSTRACT

PURPOSE: To achieve a diagnosis of abnormality of a sensor at a low cost and accurately, by erasing a time item of output signals of two sensors by a linear regression formula to rearrange a characteristic difference between both the sensors by three parameters.

CONSTITUTION: Sensors Al and B2 send an output A7 and an output B8 to a sensor abnormality diagnosing device 5 with respect to the same process variable 6. A linear regression formula B=.alpha..A+.beta. is determined with a linear regression analyzer 3 within the device 5 and to be sent to a fuzzy inferring device 4. The inferring device 4 performs extraction of an abnormality sensor from positions of center of gravity (mA and mB), an intercept .beta. and the state of a tilt .alpha. to diagnose the cause thereof and the results 9 of diagnosis are outputted.



	N	0	P	
1				
	\	/ \		
اہ				
0 —	-0.2	0	0.2	
			_	- B (*75 )



第 3 図

: ZER0

1 1 1 1	7 : ZERO	G : GAIN	S: SMALL	B: 81G	P : POSITIVE	N : NEGATIVE	
മ		<b>5</b> 2		ပ		9Z	
_		7		OK		7	
			Ţ				

図 882

m^ m B	N N	Σ	Z	Μ	РВ
PB	AB	В	В	B	ОК
PM	4	AB	В	ОК	A
Z	A	4	OK	А	∢
ΣX	A	OK	В	AB	∢
ei Z	OK	8	B	В	A B

В	92	9	9Z
1	7	OK	7
5	92	9	52
) a	۵	0	z

第4 図

NB: NEGATIVE BIG. NM: NEGATIVE MEDIUM 2: ZERO PM: POSITIVE MEDIUM, PB: POSITIVE BIG

## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

64001914

PUBLICATION DATE

06-01-89

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 24-06-87 62155546

APPLICANT: MITSUBISHI HEAVY IND LTD;

INVENTOR: ONISHI TAKASHI;

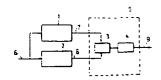
INT.CL.

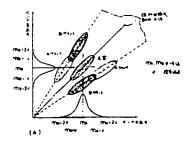
G01D 21/00 G01N 27/00

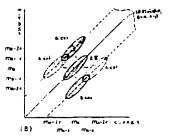
TITLE

DIAGNOSIS OF SENSOR

**ABNORMALITY** 







### ABSTRACT :

PURPOSE: To achieve a diagnosis of abnormality of a sensor at a low cost and accurately, by erasing a time item of output signals of two sensors by a linear regression formula to rearrange a characteristic difference between both the sensors by three parameters.

CONSTITUTION: Sensors A1 and B2 send an output A7 and an output B8 to a sensor abnormality diagnosing device 5 with respect to the same process variable 6. A linear regression formula B=α.A+β is determined with a linear regression analyzer 3 within the device 5 and to be sent to a fuzzy inferring device 4. The inferring device 4 performs extraction of an abnormality sensor from positions of center of gravity (mA and mB), an intercept  $\beta$  and the state of a tilt  $\alpha$  to diagnose the cause thereof and the results 9 of diagnosis are outputted.

COPYRIGHT: (C) JPO

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

P D ⑪特許出願公開 S

# ⑫公開特許公報(A)

昭64-1914

(s) Int Cl.4

證別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和64年(1989)1月6日

G 01 D 21/00 G 01 N 27/00

Q - 7809 - 2F D - 6843 - 2G

発明の数 1 未請求 (全4頁) 審査請求

センサ異常診断方法 の発明の名称

> ②特 昭62-155546 頭

昭62(1987)6月24日 ②出 鲄

野 念祭 明 者 小

秀隆

鏸

神奈川県横浜市中区錦町12番地 三菱重工業株式会社横浜

研究所内

西 仓発 頣 者 大

神奈川県横浜市中区錦町12番地 三菱重工業株式会社横浜

研究所内

三菱重工業株式会社 人 ②出

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

外2名 弁理士 鈴江 武彦 ②代 理 人

> ۵Ħ 钿 #

1. 発明の名称

センサ異常診断方法

2. 特許請求の範囲

関連する2つのセンサの出力信号間の線形回帰 式を求め、その式の傾きと切片および重心の変化 から、前記2つのセンサの中の異常センサを検出 し、同時にその異常原因がセンサのゲイン変化か またはドリフト発生かを判定することを特徴とす るセンサ異常診断方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ブラント異常診断システムの前処理 装置に適用し得るセンサ異常診断方法に関する。

[従来の技術]

従来、センサ異常診断には、同一センサを3つ 以上配置して、多数決により異常センサを抽出し ていた。しかしこの方法では、コストアップとな るので、その適用が限定されていた。このため 2 つのセンサを用い、その偏差チェック等で異常検 出を実施する場合が多いが、どちらのセンサが異 常であるのかを特定することができなく、またセ ンサの異常の状態を推定することもできなかった。

[発明が解決しようとする問題点]

2 つのセンサを用いる従来のセンサ異常診断方 法においては、前記の如く、2つのセンサの出力 信号間の偏差にのみ着目し、その大小で異常、正 **常を判定するものであるから、異常センサの検出** が困難であるとともに、異常の状態の判定も困難 であった。

本発明は上記従来の問題点を解消し、2つのセ ンサを配置した場合でも、異常センサを検出し、 同時に異常の原因を判定することができるセンサ 異常診断方法を提供することを目的とする。

本発明によれば、2つのセンサの出力信号間の 線形回場式を求め、その傾き、切片および重心が、 両センサの状態によって独立の変化を示すことを 利用して、上記機能を実現可能としたものである。 ただし、傾き、切片および重心の変化量は、セン サの特性、配置するプロセスの特性で変わるため、 その処理にファジィ推論を利用するようになされている。ここでファジィ推論とは、信号の状態をメンバシップ関数と呼ばれる帰属度関数を定義してファジィ集合で表現し、集合演算を行うことで状態の変化を推論するものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明によるセンサ異常診断方法は、2つのセンサの出力信号間の関係を線形回帰式で表現し、その式の傾き、切片および重心の変化を、例えば、ファジィ推論等の方法によって処理することにより、異常センサを特定し、かつ異常の原因を推論することを特徴とする。

[作用]

本発明によれば、線形回帰式により、2つのセンサの出力信号の時間項を消去し、両者の特性の変を3つのパラメータで表現し直すことができ、また例えば、ファジィ推論により、パラメータの変化判断をセンサやプロセスの特性を加味のあいをし、通常の大小判断に比べ、正常と異常のあいまいな段階まで処理可能となる。

び第 5 図はファジィ推論のルールテーブルを示し、記号は、個々に対応するメンバシップ関数名を示している。

上記本発明の一実施例の原理と方法について説明する。

[実施例]

第1 図は本発明方法を実施するのに用いられる 装置の一例を示すプロック図であり、1 はセンサ A、2 はセンサ B、3 は線形回帰分析器、4 はファジィ推論器、5 はセンサ 異常診断装置、6 はプロセス変量、7 は出力 A、8 は出力 B、9 は診断 結果を示す。

第1図において、センサA1とセンサB2は、同一のプロセス変量6に対して、出力A7と出力B8とをセンサ異常診断装置5に送る。センサ異常診断装置5内では、線形回帰分析器3により線形回帰式B=a・A+Bを求め、ファジィ推論器4に送る。ファジィ推論器4は、重心位置(m A A に送る。ファジィ推論器4は、重心位置(m A A に送る。ファジィ推論器4は、重心位置(m A A に送る。ファジィ推論器4は、重心位置(m A A に送る。ファジィ推論器4は、重心に対している。

第2図は異常チェックの原理を示し、第2図(A)はゲイン変化、第2図(B)はドリフト発生の場合であり、第3図は、メンバシップ関数を定義している。関数の形は対象によって決定するが、ここでは正規分布関数を用いている。第4図およ

である。

ただし上の判定は次の前提条件が満たされている時に限られる。

(i) A, Bセンサの異常発生の程度、時間は 独立事象として扱うことが出来る。

(11) 一定値へのへばりつきはない。へばりつきが発生した時は線形回帰による状態判定は行なわない。 異常センサの抽出は重心移動で判定可能。

前記三個のパラメータの変化を追跡すれば状態の判定が可能であると、基準値の設定の日でであると、基準値の設定がある。はまり危険性が大きく変ってしまり危険性がある。特にセンサの健全性が終やによる誤動作を除外する場合とを同時に実現するのは困難を伴う。

本実施例では、変化の追跡をファジィ推論と統計処理により実施し、問題の解決を計った。

第3図はメンバシップ関数の形を定義しており、 正規分布関数を用いている。台集合は各平均値と 標準偏差値を用いて逐次決定しており、プロセス の経時変化にも近従出来る。また、傾き、切片の台集合については、固定的な値を用いているが、いずれも対象とするセンサの特性を加味して経験的に決める値である。

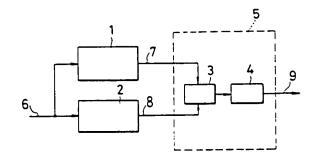
#### [発明の効果]

本発明によれば、センサの異常診断が安価にかつ確実に実施可能となり、ブラント異常診断システム等を構築する際の前処理装置として各方面で利用可能となり、実用性大である等の優れた効果が奏せられる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法を実施するのに用いられる 装置の一例を示すプロック図、第2図は本発明方 法におけるセンサ異常チェック原理図、第3図は メンバシップ関数を定義する図、第4図および第 5図はファジィ推論のルールテーブルを示す図で ある。

1 …センサA、2 …センサB、3 …線形回帰分析器、4 …ファジィ推論器、5 …センサ異常診断装置。



第1 図

